HMDS真空箱 ◆ 高真空干燥箱
半导体电子真空干燥箱

新产品

真空度达 3.5×10^{-3}pa
3.5×10^{-5}pa

用途概述

HMDS真空干燥箱用于半导体晶圆在进行HMDS预处理工艺中的干燥，通过程序设定，使抽真空-通氮气-抽真空-等实现自动控制，自动实现HMDS预处理工艺过程，用于光刻过程的涂胶工艺；
高真空干燥箱可在洁净环境下使用，满足洁净环境下的高真空，无尘生产工艺，半导体晶圆生产工艺车间使用，用于半导体、电子、医疗卫生、仪器仪表等领域的无氧化干燥工艺；

产品特点

- 采用智能触摸屏控制，温度、真空度、时间等直接设定，菜单式操作，操作维护方便；
- 工作室采用316不锈钢，更好耐酸碱腐蚀，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体，一目了然；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题；（选配）
- 低噪声专业真空泵，真空控制稳定可靠；（HMDS真空干燥箱）
- 采用内胆加热，箱体内无任何电子元器件，无污染，不易被腐蚀，使用更加安全；
- 采用超高真空泵，能够保证箱体内真空度达3.5×10^{-4}Pa；(高真空干燥箱)
- 具有485通讯接口，可以通过外置软件程序实时查看设备运行状况和程序运行状况，保证设备一直运行在监控当中；



HMDS/半导体电子真空箱

温度程序自动控制

- 真空干燥(实验)箱具有温度程序控制，可直接设定定制模式或者程序升温模式；
- 温度程序控制可实现升温、恒温全流程分段控制， 满足各类复杂温度实验需求；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；

真空程序控制 定制程序（选配）

- 真空干燥(试验)箱可分别设定最高、最低真空度，配备惰性气体自动进气系统，与电子式真空计及程序控制系统联动，自动完成真空度交替循环工艺，满足复杂的真空干燥工艺要求；
- 最大支持99次循环，满足多次循环干燥工艺需求；

技术参数

型号 / 技术指标	HMDS真空干燥箱		高真空干燥箱	
	BPZ-6060MS	BPZ-6090MS	BPZ-6060HV	BPZ-6090HV
电源电压	AC220V 50Hz		AC220V 50Hz	
输入功率	3000W	3500W	3000W	3500W
控温范围	RT+10~250℃		RT+10~200℃	
温度分辨率/波动度	0.1℃ /±1℃		0.1℃ /±1℃	
达到真空度	100Pa		3.5×10^{-3}Pa /3.5×10^{-5}Pa	
真空度显示	电子式真空度显示		电子式真空度显示	
工作环境温度	+5～40℃		+5～40℃	
内胆尺寸(mm)W×D×H	400×400×400	450×450×450	400×400×400	450×450×450
外形尺寸(mm)W×D×H	600×570×1390	610×590×1350	600×570×1390	610×590×1350
搁板	2块		2块	
加热方式	内胆加热		内胆加热	
工作室材料	316不锈钢		316不锈钢	

注：外壳可定制为304不锈钢材质；

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

生化/霉菌培养箱 01 03
低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05
生物安全低温培养箱 06
半导体制冷低温培养箱 07
生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10
隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13
玻璃发酵罐 14
CO_2培养箱 15
光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28
回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37
恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40
落地振荡器 41
摇瓶机 42
叠加式-CO_2振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45
超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49
液相液氮罐 50
生物安全柜 52
洁净工作台 53
干燥箱 55
真空干燥箱 62
加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75
油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80
药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91
老化试验箱 92
热空气消毒箱 92
高低温(交变)试验箱 93
高低温(交变)湿热试验箱 95
紫外耐气候试验箱 97 98
氙灯耐气候试验箱 99
盐雾腐蚀试验箱 100
电阻炉 101 104
旋转蒸发仪 105
耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110
干式冷阱 111
磁力搅拌器 112
顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117
离心机 118
漩涡混匀仪 118
多管漩涡混匀仪 119
孵育器/金属浴 120
微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123
粘度计 125 130